

# 红外 CCD 注入效率的理论分析

陈东波

(北京工业学院工程光学系)

**摘要**——本文从理论上导出直接注入式混合红外 CCD 注入效率公式，该式比 Steckl 的注入效率公式更完整，增加了  $C_D/C_{gs}$  项。用典型参数值分别代入两个注入效率公式进行计算，发现结果有差别。

## 一、引言

直接混合红外电荷耦合器件(IR-CCD)在最近几年有较大的发展，目前，国内外都在进行理论和实验方面的研究。在对 IR-CCD 机理的研究中，如何提高其注入效率是关键问题，许多学者对注入效率进行了理论探讨<sup>[1]</sup>，均引用 Steckl 推导的注入效率公式<sup>[2]</sup>。作者从理论上重新推导了注入效率公式，计算机计算结果表明有必要对 Steckl 公式进行修正。本文旨在介绍作者导出的 IR-CCD 注入效率公式，并讨论各种因素对注入效率的影响。

## 二、注入效率公式的推导

直接注入混合 IR-CCD 是由 P-InSb 光伏探测器与 N 沟道 CCD 构成的，其等效电路如图 1。根据等效电路图可写出下列方程：

$$i_D = i_1 + i_2, \quad (1)$$

$$i_1(G_D + j\omega C_D)^{-1} = i_2(g_m + j\omega C_{gs}), \quad (2)$$

式中  $i_D$  为红外探测器总电流(可以看作是频率等于光学调制频率的交流电流)， $\omega$  为光学调制频率， $i_1$  为探测器电流， $i_2$  为输入 CCD 电流， $G_D$  和  $C_D$  分别表示探测器的电导和电容， $g_m$  和  $C_{gs}$  分别表示输入 CCD 场效应管的跨导和输入 CCD 的电容。

根据注入效率定义，可知混合 IR-CCD 的注入效率

$$\eta_{inj}(\omega) = \frac{|i_2|}{|i_D|} = \left| \frac{g_m + j\omega C_{gs}}{(g_m + G_D) + j\omega(C_D + C_{gs})} \right|$$

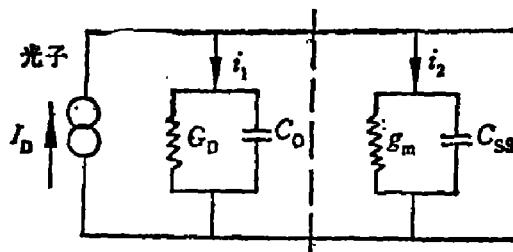


图 1 直接注入混合 IR-CCD 的等效电路  
Fig. 1 Equivalent circuit for direct injection hybrid IR-CCD

本文 1985 年 12 月 30 日收到。修改稿 1986 年 3 月 15 日收到。

$$= \frac{g_m}{g_m + G_D} \cdot \frac{P}{1 + \omega^2 [(C_D + C_{gs}) / (g_m + G_D)]^2} \quad (3)$$

式(3)中  $P$  定义为

$$P = 1 + \omega^2 \cdot \frac{2C_{gs}^2 (1 + G_D/g_m + C_D/C_{gs}) + H/g_m^2}{(g_m + G_D)^2}, \quad (4)$$

其中  $H = [g_m^2 C_{gs}^2 + G_D^2 C_{gs}^2 + \omega^2 C_{gs}^2 (C_D + C_{gs})^2]$ 。将式(4)代入式(3)得到注入效率公式:

$$\eta_{\text{注入}}(\omega) = \frac{g_m}{g_m + G_D} \cdot \frac{\left\{ 1 + \omega^2 \frac{2C_{gs}^2 (1 + G_D/g_m + C_D/C_{gs}) + H/g_m^2}{(g_m + G_D)^2} \right\}^{1/2}}{1 + \omega^2 [(C_D + C_{gs}) / (g_m + G_D)]^2}. \quad (5)$$

式(5)是作者导出的 IR-CCD 的注入效率公式,与 Steckl 推导的注入效率公式<sup>[2]</sup>

$$\eta_{\text{注入}}(\omega) = \frac{g_m}{g_m + G_D} \cdot \frac{\left\{ 1 + \omega^2 \frac{2C_{gs}^2 (1 + G_D/g_m) + H/g_m^2}{(g_m + G_D)^2} \right\}^{1/2}}{1 + \omega^2 [(C_D + C_{gs}) / (g_m + G_D)]^2} \quad (6)$$

相比,可以发现式(5)比式(6)多  $C_D/C_{gs}$  项,作者认为此项是不应忽略的。可以证明,  $C_D/C_{gs}$  与  $G_D/g_m$  或与其它项相比,要大一个数量级,至少也有相同的数量级。例如,取红外探测器的典型参数值为  $G_D = 200 \mu\Omega^{-1}$ ,  $C_D = 20 \text{ pF}$ ,而 CCD 在 77 K 下,输入抽头的典型参数值为  $g_m = 500 \mu\Omega^{-1}$ ,  $C_{gs} = 1 \text{ pF}$ ,可算得  $C_D/C_{gs} = 20$ ,  $G_D/g_m = 0.4$ 。由此可见,  $C_D/C_{gs}$  项远大于  $G_D/g_m$  项。所以,在式(6)的  $(1 + G_D/g_m + C_D/C_{gs})$  项中,没有忽略  $G_D/g_m$  项,反而忽略了  $C_D/C_{gs}$  项,这是没有理论根据的。我们认为有必要将式(6)按式(5)的形式进行修正。

### 三、注入效率分析

我们对注入效率随频率的变化关系作如下分析:

(1) 当  $\omega \rightarrow 0$  时,由式(5)可得

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \eta_{\text{注入}}(\omega) = \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_D}, \quad (7)$$

此时  $g_m R_D$  的值较大,即  $g_m R_D \gg 1$ ,式(7)变成  $\eta_{\text{注入}}(0) = 1$ ,可见  $\eta_{\text{注入}}(0) \rightarrow 1$  时能得到较高的注入效率。

(2) 当频率在 1 MHz 范围内,并且光子探测器性能较好时,可由式(5)得到注入效率

$$\eta_{\text{注入}}(\omega) = \frac{\eta_{\text{注入}}(0)}{1 + \omega^2 [(C_D + C_{gs}) / (g_m + G_D)]^2}, \quad (8)$$

式中  $\eta_{\text{注入}}(0) = g_m / (g_m + G_D)$ 。当频率增高时,  $\eta_{\text{注入}}(\omega)$  随  $\omega$  增大而衰减,将  $\eta_{\text{注入}}(\omega)$  对  $\omega$  求导,可得

$$\eta_{\text{注入}}(\omega) = (1 + 4\pi^2 f^2 \tau^2)^{-1/2}, \quad (9)$$

式中  $\tau = (C_D + C_{gs}) / (g_m + G_D)$ 。可见,注入效率与频率有关。IR-CCD 的光学调制频率不能过高,否则,注入效率将随频率增大而衰减,这样就限制了探测器列阵的光扫描速度。因此,在实际应用中规定  $\omega = \frac{1}{\tau}$  为最大允许光学调制频率,即  $f_{\text{max}} = (1 + g_m R_D) / 2\pi R_D C$ ,其中  $C = C_D + C_{gs}$ 。

(3) 高频时,  $\omega \rightarrow \infty$ ,由式(5)可得

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \eta_{\text{注入}}(\omega) = \eta_{\text{注入}}(\infty) = C_{gs} / (C_D + C_{gs}). \quad (10)$$

我们使用前述的典型参数值,代入式(10),得到 InSb-COD 低频工作时  $\eta_{\text{注入}}(\omega) = 0.048$ ; 高频工作时  $\eta_{\text{注入}}(\omega) = 0.714$ 。也就是说,InSb-COD 的漏电导要小,COD 的跨导也要小,才能获得最佳注入效率。

#### (4) 在饱和区, 跨导为<sup>[8]</sup>

$$g_m = \left[ \frac{2Z\mu_e C_{iD}}{L} \right]^{1/2}, \quad (11)$$

式中  $Z$  为 COD 沟道宽度,  $L$  为 COD 的电极长度,  $\mu_e$  为电子迁移率,  $C_i$  为绝缘体单位面积电容。由式(11)可知,当注入电流减小时,  $g_m$  也随之减小,使  $\eta_{\text{注入}}$  也减小,即  $\eta_{\text{注入}}$  与  $g_m$  之间存在迭代效应。此外,  $g_m$  与输入抽头电路纵横比成正比,而  $C_{gs}$  与源扩散区和输入极之间的重迭面积和绝缘层的厚度有关。

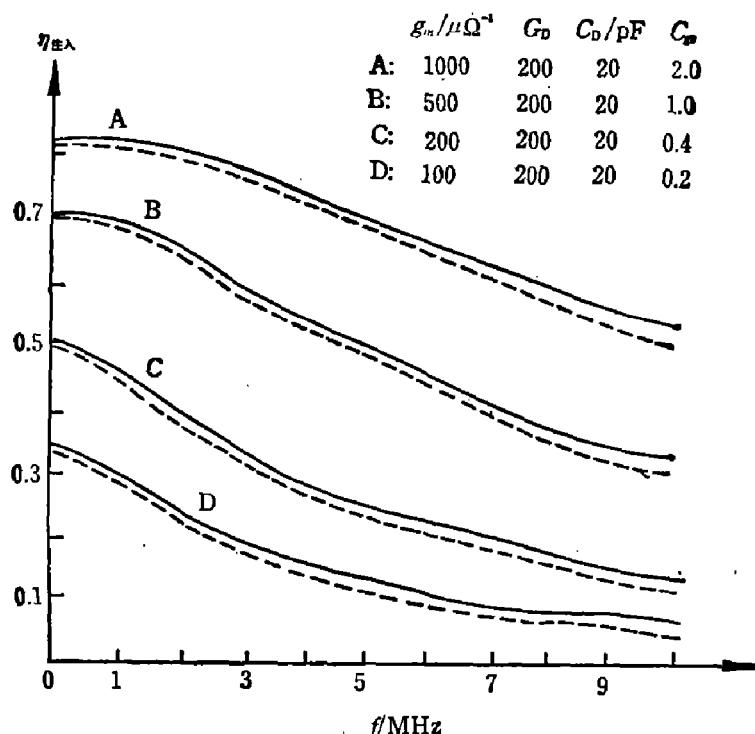


图 2 输入抽头纵横比不同时注入效率随频率的变化曲线

Fig. 2 Injection efficiency vs frequency, for the different aspect ratio of the input pin

由于红外探测器的  $C_D$  远大于  $C_{gs}$ ,所以增大输入抽头电路的宽度来改进跨导不会对总电容产生影响。当改变输入抽头沟道宽度时,得到 COD 输入电路参数不同值的注入效率随频率变化的关系曲线如图 2 所示(图中实线对应式(5)、虚线对应式(6))。由图 2 可以看出,当参数相同时,式(5)与式(6)存在着差异。在低频时差异较小,高频时差异较大。

## 四、注入效率与典型参数的计算机分析

为了说明红外探测器与 COD 输入电路参数对注入效率与频率的关系,本文利用有关文献提供的典型参数,分别代入式(5)、(6),用计算机计算了注入效率随频率的变化曲线。图 2 中的曲线对应于输入抽头电路宽度产生的 COD 输入电路不同参数值,因此,输入电路的纵横比和总面积都是变化的,这样就同时影响  $g_m$  和  $C_{gs}$ 。曲线 A 适用于  $Z/L=20$ ,由此得

到  $g_m = 100 \mu\Omega^{-1}$ ,  $C_{ss} = 2 \text{ pF}$ , 因为这时  $\eta_{注入}$  较高, 达 83%, 故所得到的注入电流大, 最小读取频率上升到 1.66 MHz。如果将 CCD 用于电视兼容的串行扫描焦平面, 频率为 5 MHz 时, 曲线 B 的  $\eta_{注入}$  为 27%, 曲线 CDD 的则更低。图 2 还表明工作频率越低, 注入效率也越低。一般来说, 注入效率不能低于 50% 才能达到实用水平。显然, 其纵横比不应小于 10, 才能获得较高的注入效率。

图 3 表示红外探测器电容值不同时注入效率的变化(图中实线对应于式(5)、虚线对应于式(6))。从图 3 可以看出, 电容值变化时,  $g_m$  随  $G_D$  的增大而增大。曲线 B 的值下降到原值的一半, 最佳工作频率下降一半, 此时注入效率为 74.3%。当探测器的电容增大, 工作频率在 0~10 MHz 范围内, 其注入效率愈来愈小, 衰减速度也越来越慢。因此, 当工作频

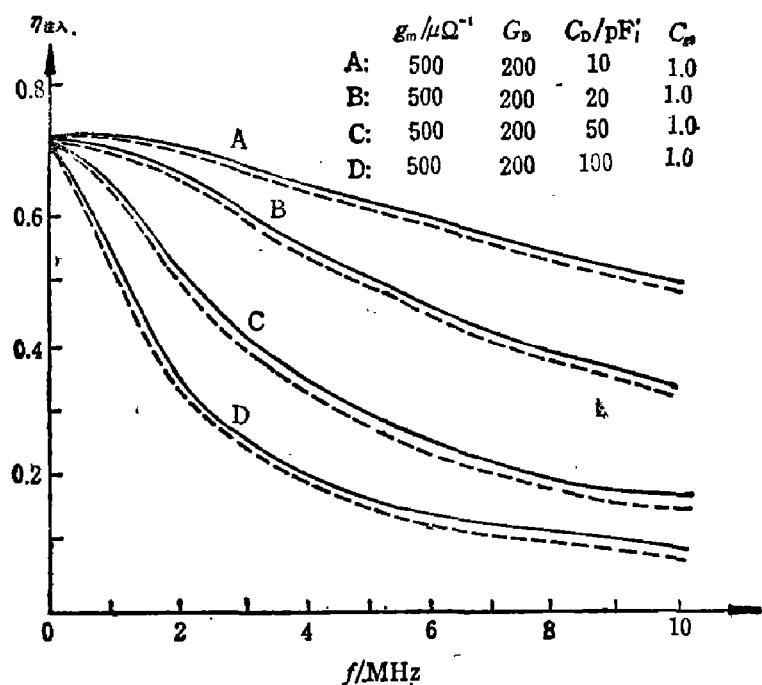


图 3 探测器电容不同时注入效率随频率的变化曲线

Fig. 3 Injection efficiency for the different capacitance of detectors

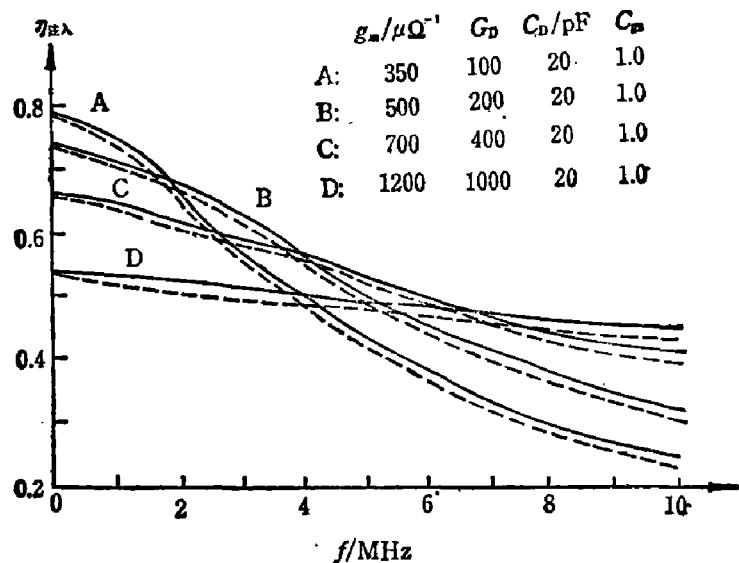


图 4 探测器电导不同时注入效率随频率的变化曲线

Fig. 4 Injection efficiency vs frequency for the different conductance of detectors

率过低时，采用电导较高的探测器为宜。

图4表示探测器电导值不同时，注入效率随频率的变化(图中实线对应式(5)、虚线对应式(6))，图中曲线B仍与图2、3中的曲线一致。从曲线A和B可以看出，在探测器电导很小的情况下，频率较低时，探测器的电导变化对注入效率影响很小。曲线B的读取频率为1.427MHz时，注入效率为71.3%。曲线A的读取频率为1.428MHz时，注入效率为71.4%，在最佳工作频率时仅提高0.07%。但在高频时，情况发生了明显的变化，这是由于电导变化引起的。当频率为5MHz时，A、B两条曲线的注入效率几乎相差一倍。探测器电导变化很大时，探测器性能恶化，此时 $\eta_{\text{注入}}$ 显著降低。

## 五、结 论

以上分析表明，当探测器的电容减小时，注入效率增大，而CCD输入电路的跨导增大时注入效率也增大。在其它参数不变的情况下， $C_D$ 增大有利于红外CCD的高频特性，而CCD输入抽头电容 $C_{ss}$ 一般很小，对注入效率影响不明显。理论分析还表明： $C_D$ 、 $C_{ss}$ 的取值应尽可能小，而提高红外探测器的动态电阻 $R_D$ 和增大CCD输入电路的跨导则是提高CCD注入效率的关键参数。

## 参 考 文 献

- [1] Tracy J. M., *Hybrid Focal Plane Construction and Operation*, in proc. IRIS Speciality Group On Infrared Detectors, San Diego, 1976.
- [2] Stell A. J., *Injection efficiency in Hybrid IR-CCD*, in proc. CCD Application Conference, San Diego, 1975.
- [3] See S. M., *Physics of semiconductor Devices*, John Wiley and Sons, New York, 1969.

## A THEORETICAL ANALYSIS OF INJECTION EFFICIENCY FOR IR-CCD

Chen Dongbo

(Department of Engineering Optics, Peking Institute of Technology)

### ABSTRACT

The formula of injection efficiency for hybrid IR-CCD in direct injection mode is derived and compared with Steckl's.